Д.М.Фреик, В.В.Прокопив, Б.М.Рувинский, О.В.Козыч, М.В.Пыц

Влияние условий выращивания на дефектную

подсистему в пленках теллурида свинца

Физико-химический институт при Прикарпатском университете им. В. Стефаника, Ивано-Франковск

I. Введение

Известно [1,2], что в халькогенидах свинца изменением состава в пределах области гомогенности можно управлять электрическими свойствами: типом проводимости и концентрацией носителей тока. Однако сейчас нет единого мнения о преобладающем виде собственных дефектов в А^{IV}В^{VI} и их зарядовом состоянии. Так, анализ диаграммы состояния и процесов отжига теллурида свинца, авторы [3] делают с предположения существования однократно заряженых акцепторов V_{ph}^{-} . Выводы о преобладании разупорядочения в подрешетке металла с образованием однократно заряженых дефектов Pb_i^+ и V_{Pb}^- , независимо от обогащения свинцом или халькогеном, сделано в работе [4]. Существуют различные взгляды и относительно зарядового состояния междоузельного свинца [5]. Если в работе [6] его считают двухкратно заряженным донором Pb_i^{2+} , то авторы [3] настаивают на *Pb*⁺_i. Ранее [7] делались также попытки объяснить эксперементальные результаты зависимости электрических параметров пленок РbTe от условий выращивания образованием однократно заряженых междоузельных атомов Pb_{i}^{+} и двухкратно заряженых вакансий V²⁻_{ph}.

В работе [8], при расчете энергетического спектра атомных дефектов, их электрическая активность объясняется с позиций двухкратно заряженых вакансий металла V_{Pb}^{2-} и халькогена V_{Te}^{2-} .

Нами впервые предложено разупорядочение металлической подрешётки теллурида свинца по механизму Френкеля с одновременным образованием как однократно, так и двухкратно заряженых дефектов: междоузельных атомов свинца Pb_i^+ , Pb_i^{2+} и вакансий свинца V_{Te}^- , V_{Te}^{2-} .

II. Методика и результаты эксперимента

Тонкие пленки РbTe выращивали с паровой фазы методом горячей стенки [9]. Подложками служили свежые сколы (111) BaF₂. Скорость осаждения пленок составляла ~ 3 нм[·]c⁻¹, а их толщина ~ 5 мкм. В качестве факторов, которые варьировались, избрано температуру подложки $T_n=400-600 \ K$ и парицальное давление пара теллура в зоне осаждения $P_{Te_2} = 10^{-4} - 1 \Pi a$. Температура испарения навески поддерживалась в интервале $T_u=820-830 \ K$, а стенок камеры $T_c=850-880 \ K$.

Электрические параметры пленок измерялись потенциометрически в постоянных электрических и магнитных полях. Химический и фазовые составы пленок, а также их структурное совершенство определяли электронно-зондовым та рентгенографическим методами.

Экспериментальные зависимости концентрации носителей тока пленок PbTe от технологических факторов их выращивания представлены на рис.1-а. Анализ этих зависимостей указывает, что как и малые значения давлений пара теллура (рис.1-а), так и низкие температуры осаждения способствуют росту материала n-типа проводимости. Увеличение P_{Te_2} ведет к уменьшению концентрации электронов, конверсии проводимости с n- на p- тип и дальнейшему росту концентрации дырок (рис.1-а).

III. Кристаллохимическая модель

Равновесие «навеска - пар» и «пар - конденсат», используя методологию [10], можно описать такой системой квазихимических реакций:

$$PbTe^{s} \leftrightarrow Pb^{v} + \frac{1}{2}Te_{2}^{2}, K_{PbTe}(T_{u}) = P_{Pb} \cdot P_{Te_{2}}^{1/2};$$

$$(1)$$

$$Pb^{V} \leftrightarrow Pb_{i}^{+} + e^{-}, K_{Pb,V}(T_{n}) = [Pb_{i}^{+}] \cdot n \cdot Pb^{-1};$$

$$(2)$$

$$\frac{1}{2}Te_{2}^{V} \leftrightarrow V_{Pb}^{-} + Te_{Te}^{0} + h^{+}, K_{Te_{2},V}^{'}(T_{n}) = [V_{Pb}^{-}] \cdot p \cdot P_{Te_{2}}^{-1/2};$$
(3)

$$Pb^{V} \leftrightarrow Pb_{i}^{2+} + 2e^{-}, K_{Pb,V}^{"}(T_{n}) = [Pb_{i}^{2+}] \cdot n^{2} \cdot Pb^{-1};$$
(4)

$$\frac{1}{2}Te_{2}^{V} \leftrightarrow V_{Pb}^{2-} + Te_{Te}^{0} + 2h^{+}, K_{Te_{2},V}^{"}(T_{n}) = [V_{Pb}^{2-}] \cdot p^{2} \cdot P_{Te_{2}}^{-1/2}.$$
(5)

Здесь уравнение (1) определяет равновесие «навеска-пар» вследствие разложения теллурида свинца в испарителе при температуре испарения T_и. Реакции (2)–(5) определяют равновесие «пар-конденсат», ответственное за образование собственных атомных дефектов при температуре осаждения (подложек) T_п.

Проявление собственной проводимости и ионизация дефектов Френкеля описывается уравнениями (6)-(8):

$$0 = e^{-} + h^{+}, K_{i}(T_{n}) = n \cdot p;$$
(6)

$$0 = V_{Pb}^{-} + Pb_{i}^{+}, K_{F}(T_{n}) = [V_{Pb}^{-}][Pb_{i}^{+}];$$
(7)

$$0 = V_{Pb}^{2-} + Pb_i^{2+}, K_F^{"}(T_n) = [V_{Pb}^{2-}][Pb_i^{2+}].$$
(8)

Общее условие электронейтральности имеет вид:

$$p + [Pb_i^+] + 2[Pb_i^{2+}] = n + [V_{Pb}^-] + 2[V_{Pb}^{2-}].$$
(9)

На основании (1)–(9) выражение для определения концентрации носителей (n) через константы равновесия квазихимических реакций К и P_{Te_3} имеет вид:

$$An^4 + Bn^3 - Cn - D = 0.$$
 (10)
Здесь

$$A = 2K_{Te_{2,V}}^{"}K_{F}^{'} \cdot P_{Te_{2}}^{1/2} \cdot (K_{PbTe}K_{Pb,V}^{'}K_{Te_{2,V}}^{'}K_{Pb,V}^{"})^{-1},$$

$$B = 1 + K_{F} \cdot P_{Te_{2}}^{1/2} \cdot (K_{PbTe}K_{Pb,V}^{'})^{-1},$$

$$C = K_{i} + K_{PbTe}K_{Pb,V}^{'} \cdot P_{Te_{2}}^{1/2},$$

$$D = 2K_{PbTe}K_{Pb,V}^{"} \cdot P_{Te_{2}}^{-1/2}.$$

Экспериментально определяемая из эффекта Холла концентрация носителей тока равна

$$n_{H} = n - p = n - K_{i} \cdot n^{-1}.$$
(11)

Кроме этого можно определить и выражения для концентраций заряженных дефектов:

$$[Pb_{i}^{+}] = K_{PbTe} K_{Pb,V}^{'} n^{-1} P_{Te_{2}}^{-1/2},$$

$$[Pb_{i}^{2+}] = K_{PbTe} K_{Pb,V}^{"} n^{-2} P_{Te_{2}}^{-1/2},$$

$$[V_{Pb}^{-}] = K_{F}^{'} \cdot n \cdot P_{Te_{2}}^{1/2} (K_{PbTe} K_{Pb,V}^{'})^{-1},$$

$$[V_{Pb}^{2-}] = K_{Te_{2},V}^{"} K_{F}^{'} \cdot n^{2} \cdot P_{Te_{2}}^{1/2} (K_{PbTe} K_{Pb,V}^{'} K_{Te_{2},V}^{'} K_{Pb,V}^{"})^{-1}.$$
(12)

Константы K_{PbTe} в уравнении (1), а также равновесия реакций образования однозарядных дефектов в PbTe $K'_{Pb,\nu}(2), K'_{Te_2\nu}(3)$ взяты из ранее определенных данных для кристаллов (таблица) [2,3]. Константу собственной проводимости K_i в уравнении (6) находили с учетом температурных зависимостей ширины запрещенной зоны $E_g(T)$ и эффективной массы плотности состояний m(T) [11]:

$$\begin{split} &K_i(T_n) = N_c \cdot N_V \cdot e^{-Eg/kT} \\ &N_c = N_V = 2(mkT/2ph^2)^{3/2}, \\ &\int m(T) = g_c^{2/3} K^{1/3} \cdot 0.048 \cdot m_0 \sqrt{T/300}, \\ &g_c = 4, K = m_{\parallel} / m_{\perp} = 9(T \ge 300K), \\ &E_g(T) = 0.217 + 4.5 \cdot 10^{-4} (T - 77)(\Im B), \\ &(T \ge 77K). \end{split}$$

Здесь m₀ – масса свободного электрона, К – константа анизотропии К электронов зоны проводимости и легких дырок в валентной зоне.

Константу К_F определяли с условий равновесия согласно

$$K_{F}^{'} = K_{PbTe}(T_{n})K_{Pb,V}^{'}(T_{n})K_{Te_{2},V}^{'}(T_{n})K_{i}^{-1}(T_{n}).$$

Учитывая, что при рассматриваемых давлениях пар можно считать идеальным газом для квазиравновесного состояния «пар-конденсат», имеем

$$K_{PbTe}(T_n) = K_{PbTe} \left(\frac{T_n}{T_e}\right)^{3/2}$$

Константы $K_{Pb,v}^{"}(T_n)$ и $K_{Te_2,V}^{"}(T_n)$ были определены на основании констант однократной ионизации.

IV. Обсуждение результатов

Расчетные результаты зависимости концентрации носителей тока и дефектов в пленках PbTe от технологических факторов (парциального давления пара теллура P_{Te_2} и температуры осаждения T_n) представлены на рис.1-2. Видно (рис.1), что результаты теоретических расчетов хорошо согласуются с экспериментом.

Следует отметить, что ответственными за изменение концентрации носителей тока (рис.1-2) являются однозарядные вакансии И междоузельные атомы свинца (рис.1-б и 2-б). Так, в частности, с ростом значений T_n и P_{Te_2} увеличивается концентрация вакансий свинца (рис.1-б – кривые 2) и уменьшается концентрация междоузельных атомов свинца (рис.1-б и 2-б – кривые 1). Теперь о двухкратно заряженных дефектах. Как показывают расчеты (рис.1-б и 2-б – кривые 3,4), их концентрация достаточно большая и составляет ~10²⁰ см⁻³, что на два порядка превышает концентрацию однозарядных (~10¹⁸ см⁻³). Это согласовывается с предположением о тенденции преобладания более многократно заряженых дефектов, способных к ионизации различной кратности, для случая наличия мелких акцепторных и донорных уровней [13,14]. Однако, поскольку значения концентраций вакансий свинца и междоузельных атомов свинца (рис.1-б и 2-б, кривые 3,4) очень близки, они почти полностью компенсируются и поэтому их вклад в изменение концентрации носителей тока в пленках PbTe несущественен.

Таким образом, проведенный кристаллохимический расчет равновесия собственных атомных дефектов в катионной подрешетке пленок PbTe дает хорошее совпадение с экспериментом в случае предположения о одновременном существовании одно- и двухкратно заряженных дефектов.

Работа частично финансировалась МП Украины (шифр темы «0197V013275»).

Список литературы

- [1] Абрикосов Н.Х., Шелимова Л.Е., Полупроводниковые материалы на основе соединений А^{IV}В^{VI}. М.: Наука, 1975. 195 с.
- [2] Зломанов В.П. Р-Т-х диаграммы двухкомпонентных систем. М.: МГУ. 1980. 132 с.
- [3] Гаськов А.М., Зломанов В.П., Новоселова А.В. // Изв.АН СССР.
 Нерган. Материалы. 1979. Т.15. №8. С.1476-1478.
- [4] Schenk M., Berger H., Kimakov A. // Cryst. Res. And Tecknol. 1988.
 V.23. №1. P.77-84.
- [5] Заячук Д.М., Шендеровський В.А. // Укр.фіз.журн. 1991. Т.36. №11. С.1692-1713.
- [6] Heinrich H. // Lect. Notes. 1980. V.133. P.407-426.
- [7] Фреик Д.М., Салий Я.П., Лищинский Н.М. // Журн.физ.химии. 1997.
 Т.71. №12. С.2135-2137.
- [8] Parada N.J., Pratt G.W. // Phys. Rev. Lett. 1969. V.22. P.180-186.
- [9] Фреик Д.М., Галущак М.А., Межиловская Л.И. Физика и технология полупроводниковых пленок. Львов: Вища школа. 1988. 152 с.
- [10] Крегер Ф. Химия несовершенных кристаллов. М.: Мир. 1969. 654 с.
- [11] Мосс Т., Баррел Г., Эллис Б. Полупроводниковая оптоэлектроника.М.: Мир. 1976.
- [12] Lopez-Otero A. //Appl. Phys. Lett. 1975. V.26. No. P.470-472.
- [13] Kroger F.A. // Phys. Chem. Sol. 1965. V.26. P.1717-1721.
- [14] Винецкий В.Л., Холодарь Г.А., Статистическое взаимодействие электронов и дефектов в полупроводниках. К.: Наук.думка. 1969.

Константы равновесия квазихимических реакций

Константы	K ₀	$\Delta H, eV$
$K_{PbTe}, Pa^{3/2}$	$1.4 \cdot 10^{18}$	3.51
$K_{Pb,V}^{'}, cm^{-6}Pa^{-1}$	$5.5 \cdot 10^{30}$	-1.01
$K_{Te_{2},V}, cm^{-6}Pa^{-1/2}$	$1.2 \cdot 10^{38}$	0.25
$K^{"}_{Pb,V}, cm^{-9}Pa^{-1}$	$1.9 \cdot 10^{51}$	-0.87
$K_{Te_{2},V}^{"}, cm^{-9}Pa^{-1/2}$	$1.0 \cdot 10^{59}$	0.39

 $K = K_0 \exp(-\Delta H / kT)$

Подписи

к рисункам статьи Фреика и др. "Влияние условий выращивания на дефектную подсистему в пленках теллурида свинца".

Рис.1. Зависимости концентрации носителей тока (а) и концентрации дефектов (б) в пленках PbTe от парциального давления пара теллура (Tn=633 K, Tu=833 K). Точки – экспериментальные данные [12], сплошные линии – расчётные кривые согласно (10),(11) – (а) и (12) – (б). Обозначения: 1 - $[Pb_i^+]$, 2 - $[V_{Pb}^-]$, 3 - $[Pb_i^{2+}]$, 4 - $[V_{Pb}^{2-}]$.

Рис.2. Зависимости расчетных значений согласно (10)-(12) концентрации носителей тока (а) и концентрации дефектов (б) в пленках PbTe от температуры осаждения ($P_{Te_2} = 2 \cdot 10^{-2}$ Па, T_{II} =833 K):1 - [Pb_i^+], 2 - [V_{Pb}^-], 3 - [Pb_i^{2+}], 4 - [V_{Pb}^{2-}].



Рис.1



Рис.2